

ТЕХНОЛОГИЯ
И
КОНСТРУИРОВАНИЕ
В
ЭЛЕКТРОННОЙ
АППАРАТУРЕ

2005 № 5 (59)

СОДЕРЖАНИЕ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

Год издания 29-й

Год регистрации 1992

Регистрационный номер
КВ 2092 от 07.06.96 г.

Зарегистрирован в ВАК по разделам
“Физико-математические науки”,
“Технические науки”

Реферируется
в Украинском РЖ “Джерело” (г. Киев)
и в Реферативном журнале ВИНТИИ
(г. Москва)

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
К.т.н. В. М. Чмиль

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

К.т.н. Н. М. Вакив
Д.т.н. В. Н. Годованюк
К.т.н. А. А. Дацковский
Д.т.н. Л. С. Лутченков
Д.т.н. В. П. Малахов
Д.т.н. В. Ф. Мачулин
В. А. Мингалёв
Е. А. Тихонова

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Д.т.н. А. А. Ащеулов
Д.ф.-м.н. А. Е. Беляев,
зам. гл. редактора
К.т.н. Э. Н. Глушеченко,
зам. гл. редактора
Д.т.н. В. Т. Дейнега
Д.ф.-м.н. В. А. Дроздов
К.т.н. И. Н. Еримич,
зам. гл. редактора
К.т.н. А. А. Ефименко,
ответственный секретарь
Д.ф.-м.н. Г. П. Ковтун
Л. М. Лейдерман
К.т.н. И. Л. Михеева
Д.т.н. С. Ю. Лузин
К.т.н. Ю. Е. Николаенко
Д.ф.-м.н. В. В. Новиков
К.т.н. В. В. Рюхтин
Д.ф.-м.н. П. В. Серба
Д.ф.-м.н. О. И. Шпотюк

УЧРЕДИТЕЛИ

Институт физики полупроводников
им. В. Е. Лашкарёва,
Научно-производственное
предприятие «Сатурн»,
Одесский национальный
политехнический университет,
Редакция журнала «ТКЭА»

Техническая политика

Состояние и проблемы развития радиоэлектронной отрасли Украины.

3

А. В. Демедюк

Электронные средства: исследования, разработки

Анализ методов синдромного декодирования кодов Рида–Соломона. И. В.
Иванова

7

СВЧ-техника

Принципиально новый подход к изготовлению СВЧ-элементов и узлов
систем связи и навигации. А. Г. Яцуценко

10

Биомедицинская электроника

Экспрессное измерение мощности ультрафиолетового излучения в спек-
тральных диапазонах УФ-А и УФ-В+С. К. В. Колежук, В. Н. Комащенко,
Н. В. Ярошенко, Г. И. Шереметова, А. С. Майстренко

13

СенсоЭлектроника. Датчики

Новое поколение пьезокерамических датчиков физических величин. В. М.
Шаратов, М. П. Мусиенко

15

Нейросетевая аппроксимация термометрической характеристики диодно-
го сенсора. Ю. М. Шварц, П. А. Яганов, В. Г. Дзюба

18

Функциональная микро- и наноэлектроника

Исследование кремниевых диффузионных резисторов при протекании им-
пульса тока большой плотности. В. В. Кушниренко, [Г. К. Нинидзе], С. П.
Павлюк, Л. Д. Коноваленко

23

Определение характеристик двухбарьерных фотодиодных структур с
металлополупроводниковыми переходами. Д. М. Ёдгорова, А. В. Каримов

27

Обеспечение тепловых режимов

Аппаратурное построение высокопроизводительных вычислительных сис-
тем с повышенной эффективностью теплоотвода. Ю. Е. Николаенко

31

Технологические процессы и оборудование

Ударостойкие защитные пленочные покрытия на основе AlN в электрон-
ной технике. А. Ф. Белянин, М. И. Самойлович, В. Д. Житковский, А. Л.
Каменева

35

Технологические предпосылки создания МОП-структур с малыми про-
ектными нормами. В. В. Баранов

42

Влияние γ-облучения на фотоэлектрические параметры InSe-гетерострук-
тур. З. Д. Ковалюк, В. Н. Катеринчук, О. А. Политанская, О. Н. Сидор

47

Установка для регенерации сорбентов в электромагнитном поле. М. И.
Головко, Ю. В. Гончаренко, В. Н. Горобец, С. М. Зотов, Ф. В. Кивва, В. Г.
Гутник, А. И. Говорищев

49

Сетевая система контроля технологического процесса выращивания по-
лупроводниковых кристаллов и тонких пленок. Р. В. Рогов, С. В. Мельни-
чук, Г. И. Воробец

52

Материалы электроники

Получение оптически однородных монокристаллов ниобата лития боль-
ших размеров. И. М. Сольский, Д. Ю. Сугак, В. М. Габа

55

Зависимость свойств толстопленочных терморезисторов от состава базо-
вой шпинели. И. В. Гадзаман, О. Я. Мруз, О. И. Шпотюк, И. М. Брунец

62

Библиография

Новые книги 9, 22, 26, 34, 51, 4-я стр. обл.

В портфеле редакции 22, 46

Выставки. Конференции 6, 41, 3-я и 4-я стр. обл.

2005 № 5 (59)

ТЕХНОЛОГІЯ
ТА
КОНСТРУЮВАННЯ
В
ЕЛЕКТРОННІЙ
АПАРАТУРІ
(російською мовою)

ЗМІСТ

Технічна політика

Стан та проблеми розвитку радіоелектронної галузі України.
O. В. Демедюк (3)

Електронні засоби: дослідження, розробки

Аналіз методів синдромного декодування кодів Ріда–Соломона.
I. В. Іванова (7)

НВЧ-техніка

Принципово новий підхід до виготовлення НВЧ-елементів та вузлів систем зв'язку та навігації.
A. Г. Яцушенко (10)

Біомедична електроніка

Експресне вимірювання потужності ультрафіолетового випромінювання в спектральних діапазонах УФ-А та УФ-В+С.
K. В. Колежук, В. М. Комашченко, М. В. Ярошенко, Г. І. Шереметова, А. С. Майстренко (13)

Сенсоелектроніка. Датчики

Нове покоління п'єзокерамічних датчиків фізичних величин.
B. М. Шарапов, М. П. Мусієнко (15)

Нейросіткова апроксимація термометричної характеристики діодного сенсору.
Ю. М. Шварц, П. О. Яганов, В. Г. Дзуба (18)

Функціональна мікро- та наноелектроніка

Дослідження кремнієвих дифузійних резисторів при протіканні імпульсного струму великої щільноти.
В. В. Кушніренко, Г. К. Нінідзе, С. П. Павлюк, Л. Д. Коноваленко (23)

Визначення характеристик двобар'єрних фотодіодних структур з металнапівпровідниковими переходами.
Д. М. Йодгорова, А. В. Карімов (27)

Забезпечення теплових режимів

Апаратна побудова високопродуктивних обчислювальних систем з підвищеною ефективністю тепловідведення.
Ю. Є. Ніколаєнко (31)

Технологічні процеси та обладнання

Ударостійкі захисні плівкові покриття на основі AlN в електронній техніці.
А. Ф. Белянін, М. І. Самойлович, В. Д. Житковський, А. Л. Каменська (35)

Технологічні передумови створення МОН-структур з малими проектними нормами.
В. В. Баранов (42)

Вплив γ -промініння на фотоелектричні параметри InSe-гетероструктур.
З. Д. Ковалюк, В. М. Катеринчук, О. А. Політанська, О. М. Сидор (47)

Установка для регенерації сорбентів в електромагнітному полі.
М. І. Головко, Ю. В. Гончаренко, В. М. Горобець, С. М. Зотов, Ф. В. Ківа, В. Г. Гутник, О. І. Говорищев (49)

Мережева система контролю технологічного процесу вирощування напівпровідникових кристалів і тонких плівок.
P. В. Рогов, С. В. Мельничук, Г. І. Воробець (52)

Матеріали електроніки

Одержання оптично однорідних монокристалів ніобата літію великих розмірів.
I. М. Сольський, Д. Ю. Сугак, В. М. Габа (55)

Залежність властивостей товстоплівкових терморезисторів від складу базової шпінелі.
I. В. Гадзаман, О. Я. Мруз, О. І. Шпотюк, I. М. Brunets (62)

CONTENT

Technical polityc

Status and problems of development of radioelectronics branch of Ukraine. *Demedyuk A. V.* (3)

Electronic means: investigations, development

The analysis of methods of syndromic decoding of codes of Read–Solomon. *Ivanova I. V.* (7)

Microwave engineering

Radically new approach to manufacturing microwave components units for communication and navigation systems. *Yatsunenko A. G.* (10)

Biomedical electronics

Quick measurement of ultraviolet radiation power in the UV-A and UV-B+C spectral ranges. *Kolezhuk K. V., Komashchenko V. N., Yaroshenko N. V., Sheremetova G. I., Maystrenko A. S.* (13)

The sensoelectronics. Sensors

New generation of piezoceramic sensors of physical values. *Sharapov V. M., Musiyenko M. P.* (15)

Neuronet approximation thermometrical characteristics of the diode temperatures sensor. *Shwarts Yu. M., Yaganov P. A., Dzuba V. G.* (18)

The functional micro- and nanoelectronics

Investigation of silicon diffusion resistors at course of a pulse of a high current. *Kushnirenko V. V., Ninidze G. K., Pavlyuk S. P., Konovalenko L. D.* (23)

Definition of characteristic of two-barrier photodiode structures with metal-semiconduction transition. *Yodgorova D. M., Karimov A. V.* (27)

Ensuring of thermal modes

Hardware build-up of high-performance computing systems with heightened efficiency of tap of heat. *Nikolayenko Yu. E.* (31)

Technological processes and development

Strengthening thin film based on AlN in electronics. *Belyanin A. F., Samoylovich M. I., Jitkovsky V. D., Kameneva A. L.* (35)

Technological prerequisites for manufacturing the MOS structures with layout of small dimensions. *Baranov V. V.* (42)

Influence of γ -radiation on electrical parameters InSe-heterostructures. *Kovalyuk Z. D., Katerinchuk V. N., Politanskaya O. A., Sidor O. N.* (47)

Equipment for sorbent regeneration in the electromagnetic field. *Golovko M. I., Goncharenko Y. V., Gorobets V. N., Zотов S. M., Kivva F. V., Gutnik V. G., Govorishhev A. Y.* (49)

Network system for control of the technological process of the growth of semiconducting crystals and thin films. *Rogov R. V., Melnychuk S. V., Vorobets G. I.* (52)

Materials of electronics

The obtaining of optical homogenous and large size lithium niobate single crystals. *Solskii I. M., Sugak D. Yu., Gaba V. M.* (55)

Effect of basic spinel composition on properties of thick film NTC thermistors. *Hadzaman I. V., Mrooz O. Ya., Shpotyuk O. I., Brunets I. M.* (62)